日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 5月15日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-137247

[ST. 10/C]:

[JP2003-137247]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社名機製作所

2004年 1月28日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

P150321-7

【提出日】

平成15年 5月15日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

B29C 45/26

G11B 07/26

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県大府市北崎町大根2番地

株式会社名機製作所

内

【氏名】

蛯名 利幸

【特許出願人】

【識別番号】

000155159

【氏名又は名称】

株式会社名機製作所

【代表者】

酒井 康一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

057200

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】 ディスク基板の成形用金型

【特許請求の範囲】

【請求項1】

固定金型と可動金型の少なくとも一方の金型にスタンパが保持されたディスク 基板の成形用金型において、

前記スタンパは、

中心孔の打抜きによって該中心孔の内周面と内周側表面との間に該内周面から連 続して拡径された被押え面が形成され、

前記スタンパの内周側を保持する内周スタンパホルダは、

本体円筒部と該本体円筒部の端部外周に形成された爪部とからなり、

該爪部は、

前記スタンパの内周側表面に対して略平行なキャビティ形成面と、

キャビティ側に向けてテーパー状に拡径され前記被押え面を押える押え面とが形 成され、

本体円筒部には前記スタンパの内周面と略等間隔に対向する円筒面が形成された ことを特徴とするディスク基板の成形用金型。

【請求項2】

固定金型と可動金型の少なくとも一方の金型にスタンパが保持されたディスク 基板の成形用金型において、

前記スタンパは、

中心孔の内周面と内周側表面との間に該内周面から連続して拡径された被押え面 が形成され、

前記スタンパの内周側を保持する内周スタンパホルダは、

本体円筒部と該本体円筒部の端部外周に形成された爪部とからなり、

該爪部は、

前記スタンパの内周側表面に対して略平行であって前記本体円筒部の円筒面から 常温時に30μmないし60μm軸線方向と垂直方向に突出して外周部が形成さ れたキャビティ形成面と、

基部の軸線方向の寸法が常温時に50μmないし150μmであり該基部における接続部から前記キャビティ形成面の前記外周部に向けてテーパー状に拡径された押え面とが形成されたことを特徴とするディスク基板の成形用金型。

【請求項3】

前記内周スタンパホルダの爪部のキャビティ形成面は、

スタンパの内周側表面に対して常温時に 5μ mないしは 25μ mキャビティ側に 突出する状態になされていることを特徴とする請求項 1 および請求項 2 に記載の ディスク基板の成形用金型。

【請求項4】

前記内周スタンパホルダの爪部の押え面は、

断面円弧状に形成されていることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載のディスク基板の成形用金型。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、CD-ROM、CD-R、DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-R等のディスク基板の成形用金型に関し、詳しくはスタンパと内周スタンパホルダに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来ディスク基板の成形用金型においてスタンパの内周側を保持する内周スタンパホルダとしては、特許文献1の(0003)、(図16)、および(図17)に示すような構造のものが一般的に用いられている。すなわちスタンパの内周側は、スタンパの表面よりキャビティ側に向けて突出した内周スタンパホルダの爪部によって鏡面板に向けて押えられている。しかし特許文献1の(図16)、(図17)のものは、スプルからキャビティ内のスタンパの情報面側に向けて溶融樹脂が流れるときに、前記した爪部によりキャビティの断面積が狭くなるため、溶融樹脂の流れが制限を受けるという問題があった。

[0003]

その問題を解決するため特許文献1では(0030)、(0031)、および(図8)に示されるように、スタンパの内周側を20°から70°の範囲にテーパー状に拡径して加工するとともに、内周スタンパホルダの爪部をそれに対応する形状としている。そしてこのような形状にすることにより、爪部はスタンパの情報面よりキャビティ側になることなく、したがって溶融樹脂の流れを損なうことがないという効果を有している。また特許文献1には(0032)、および(図9)に示すスタンパの内周側と内周スタンパホルダの爪部との組合わせによっても前記同様の効果を有することが記載されている。

[0004]

【特許文献1】

特開平5-54427号公報(0003)、(0030)、(00 31)、(0032)、(図8)、(図9)、(図16)、(図17)

[0005]

また前記特許文献1と同様のものとしては、特許文献2の(0013)、および(図4)に示されるもの、特許文献3の(図5)、および(図6)に示されるものが知られている。

[0006]

【特許文献2】

特開平10-302328号公報(0013)、(図4)

【特許文献3】

実開昭62-80620号公報(図5)、(図6)

$[0\ 0\ 0\ 7\]$

前記特許文献1ないし特許文献3に記載されたものは、いずれもスタンパの内 周側を特定の形状に加工する必要があった。またディスク基板の成形時にスタン パは、内周スタンパホルダとの間の熱膨張の差や溶融樹脂の圧力のために僅かに 移動するが、内周スタンパホルダの爪部の下にスタンパの内周側が完全に嵌合さ れているため、スタンパの内周部の強度が不足し、スタンパの寿命が短くなると いう問題があった。

[0008]

また、スタンパの中心孔を成形するものとしては、特許文献4の(図1)、および(図4)に記載のものが知られ、前記装置により、(図3のb)、および(図5のb)に示されるスタンパの中心孔付近の形状が形成されることが知られている。しかし、このようなスタンパの中心孔付近の形状を再加工せず、しかも内周スタンパホルダの爪部をキャビティ側に突出させずにスタンパを保持することは誰もが不可能と考え実行していなかった。

[0009]

【特許文献4】

登録実用新案3032851号公報(図1)、(図3のb)、(図4)、(図5のb)

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

本発明では、上記の問題を解決するために、溶融樹脂の流れを良好にすることを目的としたディスク基板の成形用金型において、内周スタンパホルダの爪部をスタンパの転写面からキャビティ側に突出させることなく、かつスタンパの内周側の強度不足を解消することを目的とする。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1に記載のディスク基板の成形用金型は、固定金型と可動金型の少なくとも一方の金型にスタンパが保持されたディスク基板の成形用金型において、スタンパは、中心孔の打抜きによって中心孔の内周面と内周側表面との間に内周面から連続して拡径された被押え面が形成され、スタンパの内周側を保持する内周スタンパホルダは、本体円筒部と該本体円筒部の端部外周に形成された爪部とからなり、該爪部は、スタンパの内周側表面に対して略平行なキャビティ形成面と、キャビティ側に向けてテーパー状に拡径され前記被押え面を押える押え面とが形成され、本体円筒部にはスタンパの内周面と略等間隔に対向する円筒面が形成されたことを特徴とする。

[0012]

本発明の請求項2に記載のディスク基板の成形用金型は、固定金型と可動金型

の少なくとも一方の金型にスタンパが保持されたディスク基板の成形用金型において、スタンパは、中心孔の内周面と内周側表面との間に内周面から連続して拡径された被押え面が形成され、スタンパの内周側を保持する内周スタンパホルダは、本体円筒部と該本体円筒部の端部外周に形成された爪部とからなり、爪部は、スタンパの内周側表面に対して略平行であって前記本体円筒部の円筒面から常温時に 30μ mないし 60μ m軸線方向と垂直方向に突出して外周部が形成されたキャビティ形成面と、基部の軸線方向の寸法が常温時に 50μ mないし 150μ mであり該基部における接続部から前記キャビティ形成面の外周部に向けてテーパー状に拡径された押え面とが形成されていることを特徴とする。

[0013]

本発明の請求項 3 に記載のディスク基板の成形用金型は、請求項 1 または請求項 2 において、内周スタンパホルダの爪部のキャビティ形成面は、スタンパの内周側表面に対して常温時に 5 μ m ないしは 2 5 μ m キャビティ側に突出する状態になされていることを特徴とする。

[0014]

本発明の請求項4に記載のディスク基板の成形用金型は、内周スタンパホルダ の爪部の押え面は、断面円弧状に形成されていることを特徴とする。

[0015]

【発明の実施の形態】

まず本発明に使用されるディスク基板の成形用金型について図1、図2を参照して説明する。図1は、本発明のディスク基板の成形用金型の断面図である。図2は、図1のディスク基板の成形用金型の要部の拡大断面図である。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

図1において、ディスク基板の成形用金型1は、図示しないディスク基板成形機の固定盤に取付けられる固定金型2と、可動盤に取付けられる可動金型3とからなっている。固定金型2は、本体部4にスプルブッシュ5、メスカッタ6、バックプレート7等が配設され、バックプレート7には鏡面板8が配置されている。またスプルブッシュ5とメスカッタ6の間にはスプル温調通路9が形成され、バックプレート7と鏡面板8の間には鏡面板温調通路10が複数周回形成されて

いる。

[0017]

一方可動金型3は、本体部11に円筒状の固定スリーブ12が配設され、固定スリーブ12の中心孔には、エジェクタスリーブ13、オスカッタ14、センターピン15が配設されている。そして固定スリーブ12の外周には内周スタンパホルダ16が装着可能となっている。また本体部11の前記内周スタンパホルダ16の外側にはバックプレート17が配設され、バックプレート17には鏡面板18が配設されている。この実施の形態においては、鏡面板18の厚さは、20mmである。鏡面板18の表面19には、スタンパ20が前記内周スタンパホルダ16と外周スタンパホルダ21によってその内周側20aと外周側が保持され装着されている。またオスカッタ14の内部にはオスカッタ温調通路22が形成され、バックプレート17と鏡面板18の間には鏡面板温調通路23が複数周回形成されている。この実施の形態では、金型を構成する鏡面板18、内周スタンパホルダ16等は、クロムを含む13Cr系ステンレス鋼、更に詳しくはSUS420J2が用いられており、熱膨張率は11.5×10-6/℃前後である。

[0018]

そして前記可動金型3の外周スタンパホルダ21の内周部に前記固定金型2の 鏡面板8の外周部が嵌合されることにより容積可変にキャビティ24が形成され る。キャビティ24には前記スプルブッシュ5の中心に形成されたスプル25が 連通されており、図示しない射出装置から前記スプル25を介してキャビティ2 4内に溶融樹脂が射出充填可能となっている。

[0019]

次に本発明に用いられるスタンパ20について図2により説明する。スタンパ20は、ニッケルまたはニッケル合金から形成されており、熱膨張率は12.8 ×10⁻⁶ / ℃程度である。スタンパ20の中心孔31は、前記特許文献4に記載されているように、転写面35である表面20b側から裏面20c側に向けてポンチにより打抜かれて成形される。ポンチによって打抜かれたスタンパ20の中心孔31は、図2に示されるように、表面20bおよび裏面20cに対して垂直な内周面32と、前記内周面32から表面20b側に向けて連続して拡径され

た被押え面33が形成される。そしてスタンパ20の表面20b側は、前記被押 え面33から連続して内周側表面34、転写面35が形成されている。

[0020]

本発明では、内周面32から連続して拡径された被押え面33が打抜きにより、形成されたものを使用することができ、上記特許文献1ないし特許文献3に記載されたようにスタンパ20の内周側20aを内周スタンパホルダ16により押えるために特別の加工を行なわないでよい。またスタンパ20の中心孔31を打抜きにより形成する際、裏面20cにバリが形成されるが、このバリがスタンパ20の取付時に障害となるときは、研磨により平らにする。しかしこのバリがスタンパ20の取付時に障害とならない程度であれば、鏡面板18の内側に環状溝を形成してバリの部分を挿入してもよい。ただしスタンパ20は、ポンチにより中心孔31が打抜かれて、被押え面33が形成されたものだけに限定されず、被押え面33を別途加工により形成したものでもよい。いずれにせよ本発明のスタンパ20は、内周面32と内周側表面34との間に拡径された被押え面33が形成されており、スタンパ20の内周側20aの部分は所定の厚みを有するものが使用される。よって特許文献1ないし特許文献3に記載されたもののように、内周部全体がテーパー状に形成されていたり、薄肉部が形成されていたりしないから、スタンパ20の内周側20aは損傷されにくい。

[0021]

次にスタンパ20の内周側20aを保持する内周スタンパホルダ16について 図2により説明する。内周スタンパホルダ16は軸線方向Aに向けて所定の長さ を有する部材であり、本体円筒部41のキャビティ側の端部外周に爪部42を有 している。本体円筒部41および爪部42のキャビティ側は、キャビティ形成面 43となっており、保持されるスタンパ20の内周側表面34と略平行となって いる。

[0022]

爪部42のキャビティ形成面43の外周部44は、常温時(20℃)に、本体円筒部41の表面である円筒面47から軸線方向Aと垂直方向に向けて50μm 突出して形成されている。また内周スタンパホルダ16の本体円筒部41と爪部 4 2 との境界部分に相当する爪部 4 2 の基部 4 5 における軸線方向 A の寸法は、常温時に 1 0 0 μ m に形成されている。爪部 4 2 と本体円筒部 4 1 とは、反キャビティ側において、前記基部 4 5 における接続部 4 5 a で接続されるように形成されている。そして前記基部 4 5 における接続部 4 5 a とキャビティ形成面 4 3 の外周部 4 4 とを結ぶようにキャビティ側に向けてテーパー状に拡径された押え面 4 6 が形成されている。そして押え面 4 6 における反キャビティ側は、断面凹状の円弧状の接続面 4 8 が形成されており、押え面 4 6 と円筒面 4 7 とは基部 4 5 の接続部 4 5 a の部分でなめらかに接続されている。よって前記押え面 4 6 の過半の部分は、テーパー面からなり、接続面 4 8 を経て円筒面 4 7 に接続されている。また前記円筒面 4 7 については、前記キャビティ形成面 4 3 と垂直方向に形成され、前記スタンパ 2 0 の内周面 3 2 と等間隔で対向されるようになっている。なお押え面 4 6 全体を凹状や凸状の断面円弧状に形成してもよい。

[0023]

そしてこの実施の形態においては、爪部42の押え面46は、窒化処理され窒化クロム層が形成されている。なお窒化クロム層については、耐摩耗特性を向上させるためのものであるが、必須のものではない。窒化クロム層については、キャビティ形成面43や円筒面47にも形成してもよい。

[0024]

なお、爪部42における外周部44の本体円筒部41の円筒面47からの軸線方向Aと垂直方向への突出寸法は、常温時に30μmないし60μmに形成されていることが望ましい。また、爪部42における基部45の軸線方向Aの寸法は、常温時に50μmないし150μmであることが望ましい。そして爪部42を上記の形状とすることにより、スタンパ20と内周スタンパホルダ16との間に溶融樹脂が入り込み、成形されたディスク基板にバリができることが防止される。またスタンパ20の浮上がりを防止し、かつ内周スタンパホルダ16およびスタンパ20の耐用回数を増加させることができる。なお、断面円弧状の接続面48については、必須のものではない。内周スタンパホルダ16のキャビティ形成面43はすべて同一平面からなることが望ましいが、爪部42のキャビティ形成面43と本体円筒部41のキャビティ形成面43とは溶融樹脂の流れを損なわな

い範囲でわずかに高さが相違していてもよい。

[0025]

次に可動金型3への、スタンパ20および内周スタンパホルダ16の取付けについて図1および図2により説明する。可動金型3の鏡面板18にスタンパ20を取付ける際は、まず先にスタンパ20の中心孔31に内周スタンパホルダ16の本体円筒部41を挿通する。そしてスタンパ20が外挿された内周スタンパホルダ16の本体円筒部41の反キャビティ側を、固定スリーブ12と鏡面板18の間の環状の隙間に挿入する。そして図示しない回転部材により内周スタンパホルダ16の反キャビティ側端面49を固定スリーブ12の当接面12aに向けて押付けるように位置決めする。上記により内周スタンパホルダ16は、鏡面板18およびスタンパ20に対して相対的な位置が決定される。

[0026]

この実施の形態では、内周スタンパホルダ16の爪部42のキャビティ形成面43は、装着されたスタンパ20の内周側表面34に対して常温時(20℃)において、15 μ mキャビティ側に突出した状態に位置決めされるよう設計されている。これは成形時における内周スタンパホルダ16の熱膨張より、鏡面板18とスタンパ20の熱膨張の方が大きいためである。よって成形時には、図2において二点鎖線で示されるように、爪部42のキャビティ形成面43と、スタンパ20の内周側表面34との高さは、略同一となるように設計されている。なおスタンパ20の内周側表面34に対する爪部42におけるキャビティ形成面43のキャビティ側への突出寸法は、鏡面板18やスタンパ20の厚さや、成形時の鏡面板18と内周スタンパホルダ16との温度差によっても相違するが、一般的には常温時に5 μ mないしは25 μ mキャビティ側に突出する状態に設計されており、成形時においては両者の高さは10 μ m以内に収まる。

[0027]

なお上記の実施の形態において、可動金型3にスタンパ20および内周スタンパホルダ16が形成される例について記載したが、固定金型2と可動金型3の少なくとも一方の金型にスタンパ20が内周スタンパホルダ16によって保持されたものであればよい。固定金型2にスタンパ20が保持される場合は、メスカッ

タ6と鏡面板8の間に内周スタンパホルダ16が取付けられる。

[0028]

次に本発明のディスク基板の成形用金型1を用いたディスク基板の成形について説明する。この実施の形態ではDVD-Rを成形するものであり、使用される樹脂はポリカーボネート、射出時のノズルにおける溶融樹脂の温度は360℃程度である。そして可動金型3の鏡面板18は鏡面板温調通路23に流通される温調媒体により120℃前後に温調され、内周スタンパホルダ16はオスカッタ温調通路22に流通される温調媒体により85℃前後に温調されている。よって内周スタンパホルダ16のキャビティ側への膨張よりもスタンパ20および鏡面板18のキャビティ側に向けての膨張の方が大きく、成形時にはスタンパ20の内周側表面34と、内周スタンパホルダ16の爪部42のキャビティ形成面43が略同一高さとなる。この際に押え面46は、キャビティ側に向けてテーパー状に拡径されており、基部45の側は、円筒面47に接続して断面円弧状の接続面48が形成されているので、スタンパ20側の膨張により、スタンパ20の内周側20aが損傷することがない。また内周スタンパホルダ16の押え面46とスタンパ20の被押え面33との間隔は、僅かな間隔に保たれるので、溶融樹脂が入り込むことはない。

[0029]

そして図示しない射出装置からスプルを介して溶融樹脂がキャビティ24に射出充填される際に、内周スタンパホルダ16の爪部42がキャビティ側に突出していなので、溶融樹脂が流れる断面積が大きくなり、キャビティ24への溶融樹脂の充填が良好に行なわれる。また本発明ではディスク基板のスタンパ側(信号が形成される面)の面を平坦に成形することができる。よってCD-ROMやCD-R等を成形した際には、ディスク基板の表面全体に装飾等を印刷することができる。またDVD-R等を成形した際には、2枚のディスク基板を貼合せる際に全面を貼合せることができる。

[0030]

本発明については、一々列挙はしないが、上記した実施の形態のものに限定されず、当業者が本発明の趣旨を踏まえて変更を加えたものについても、適用され

ることは言うまでもないことである。

[0031]

【発明の効果】

本発明の請求項1に記載のディスク基板の成形用金型は、打抜きによって形成されたスタンパの被押え面を、テーパー状に拡径された爪部の押え面によって押えることができ、スタンパの被押え面を特別に加工することなく、かつ樹脂の流動を良好にすることができる。

[0032]

本発明の請求項 2 に記載のディスク基板の成形用金型は、内周スタンパホルダの爪部を、保持されたスタンパの内周側表面に対して略平行に常温時に $30 \mu m$ ないし $60 \mu m$ 軸線方向と垂直方向に突出して外周部が形成されたキャビティ形成面と、基部の軸線方向の寸法が常温時に $50 \mu m$ ないし $150 \mu m$ であり該基部からキャビティ形成面の外周部に向けてテーパー状に拡径された押え面とにより形成し、スタンパの中心孔の内周面と内周側表面の間に形成された被押え面を押えるようにしたので、スタンパの内周側の爪部の耐久性を高めるとともに、スタンパを確実に保持することができる。また樹脂の流動を良好にするとともに、スタンパと内周スタンパホルダの隙間にバリが発生することによるディスク基板の成形不良を解消することができる。

[0033]

本発明の請求項3に記載のディスク基板の成形用金型は、内周スタンパホルダの爪部のキャビティ形成面は、スタンパの内周側表面に対して常温時に 5μ mないしは 25μ mキャビティ側に突出する状態にしておくことにより、成形時に樹脂の流動を良好にするとともに、成形品における内周側表面と内周スタンパホルダのキャビティ形成面との段差をなくすか、ごく僅かにすることができる。

[0034]

本発明の請求項4に記載のディスク基板の成形用金型は、内周スタンパホルダの爪部の押え面は、断面円弧状に形成することにより、成形時にスタンパ側が熱膨張した際に、スタンパの内周側の損傷をより一層防止することができる。

【図面の簡単な説明】

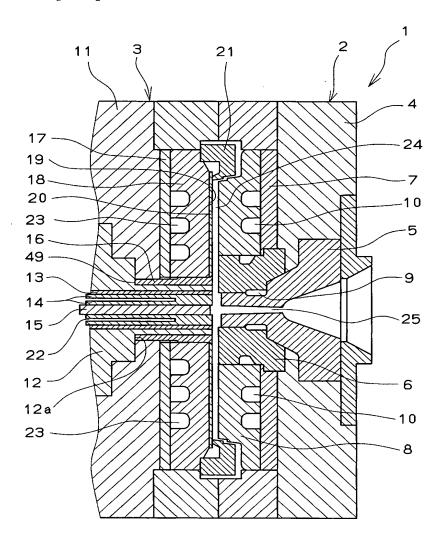
【図1】

【図2】

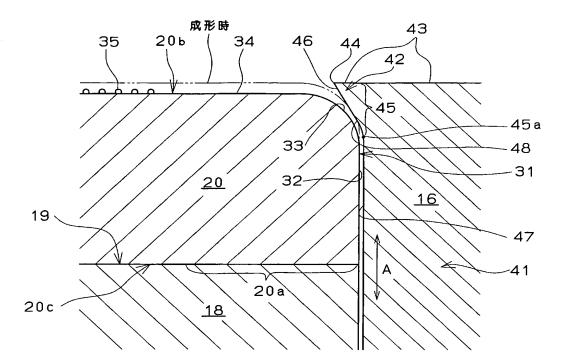
- 1 …… ディスク基板の成形用金型
- 2 …… 固定金型
- 3 …… 可動金型
- 4 …… 本体部
- 5 …… スプルブッシュ
- 6 …… メスカッター
- 7 …… バックプレート
- 8 …… 鏡面板
- 9 …… スプル温調通路
- 10 …… 鏡面板温調通路
- 11 …… 本体部
- 12 …… 固定スリーブ
- 1 2 a …… 当接面
- 13 …… エジェクタスリーブ
- 14 …… オスカッタ
- 15 …… センターピン
- 16 …… 内周スタンパホルダ
- 17 …… バックプレート
- 18 …… 鏡面板
- 19 …… 表面
- 20 …… スタンパ
- 20 a …… 内周側
- 20b …… 表面
- 20 c …… 裏面

- 21 …… 外周スタンパホルダ
- 22 …… オスカッタ温調通路
- 23 …… 鏡面板温調通路
- 24 …… キャビティ
- 25 …… スプル
- 3 1 …… 中心孔
- 3 2 …… 内周面
- 33 …… 被押え面
- 3 4 …… 内周側表面
- 3 5 …… 転写面
- 4 1 …… 本体円筒部
- 4 2 …… 爪部
- 43 …… キャビティ形成面
- 4 4 …… 外周部
- 4 5 …… 基部
- 4 5 a …… 接続部
- 46 …… 押え面
- 4 7 …… 円筒面
- 4 8 …… 接続面
- 49 …… 反キャビティ側端面
- A …… 軸線方向

【書類名】 図面 【図1】



【図2】



ページ: 1/E

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 溶融樹脂の流れを良好にすることを目的としたディスク基板の成形 用金型において、内周スタンパホルダの爪部をスタンパの転写面からキャビティ 側に突出させることなく、かつスタンパの内周側の強度不足を解消する。

【解決手段】 ディスク基板の成形用金型1において、スタンパ20は、中心孔31の打抜きによって中心孔31の内周面32と内周側表面34との間に内周面32から連続して拡径された被押え面33が形成され、スタンパ20の内周側20aを保持する内周スタンパホルダ16は、本体円筒部41と爪部42とからなり、爪部42は、スタンパ20の内周側表面34に対して略平行なキャビティ形成面43と、キャビティ側に向けてテーパー状に拡径され前記被押え面33を押える押え面46とが形成され、本体円筒部41にはスタンパ20の内周面32と略等間隔に対向する円筒面47が形成される。

【選択図】

図 2

特願2003-137247

出願人履歴情報

識別番号

[000155159]

1. 変更年月日 [変更理由]

 1990年 8月 8日

新規登録

愛知県大府市北崎町大根2番地

株式会社名機製作所